

※課題番号 : F-12-KT-0137
※支援課題名 (日本語) : 光学機能性材料の加工性開発
※Program Title (in English) : Development of Workability for Optical Functionality Materials
※利用者名 (日本語) : 清元 智文
※Username (in English) : Tomofumi Kiyomoto
※所属名 (日本語) : 株式会社リコー
※Affiliation (in English) : RICOH COMPANY, LTD

※概要 (Summary) :

【相談内容】

光学デバイス向けに反射層として AgPdCu 膜のパターン形成を検討しており、その微細化限界の確認を必要としている。

今回はステッパによりレジストパターンを形成し、社内設備によりエッチング条件を検討することを目的としている。

【希望利用装置】

- ・露光装置 (ステッパ)
- ・レジスト現像装置

【回答】

上記の装置群を利用していただいで希望するデータを得る事が可能と考えられる。

【結果】

平成 24 年度末から自主事業テーマとしてナノハブの利用を開始。

※実験 (Experimental) :

技術相談のため割愛

※結果と考察 (Results and Discussion) :

技術相談のため割愛

※その他・特記事項 (Others) :

なし